

665827-2026 - Wettbewerb

Schweiz – Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) – Eine Sputter-Abscheidungsanlage, speziell für die Herstellung von qualitativ hochwertigen supraleitenden Dünnschichten

OJ S 187/2026 28/09/2026

**Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Lieferleistungen**

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: EPFL-Scientific Equipment

E-Mail: jerome.buty@epfl.ch

Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Eine Sputter-Abscheidungsanlage, speziell für die Herstellung von qualitativ hochwertigen supraleitenden Dünnschichten

Beschreibung: Die EPFL plant in enger Zusammenarbeit mit der Universität Genf (UNIGE) die Anschaffung einer hochmodernen Sputter-Abscheidungsanlage, die speziell für die Herstellung von qualitativ hochwertigen supraleitenden Dünnschichten konzipiert ist. Die Anlage wird im EPFL Center of MicroNanotechnology (EPFL CMi) installiert und betrieben. Das CMi ist eine zentralisierte Einrichtung für die Mikro- und Nanofabrikation, die allen Fakultäten der EPFL dient und sowohl externen Universitäten als auch lokalen Industriepartnern offensteht (über 600 aktive Nutzer pro Jahr). Die neue Anlage wird für Spitzenforschung im Bereich der Einzelphotonendetektoren eingesetzt, mit dem Ziel, die Lücke zwischen der Laborfertigung und der industriellen Produktion zu schließen, indem sie die Abscheidung auf Wafern mit einem Durchmesser von 200 mm ermöglicht. Besonderes Augenmerk wird nicht nur auf die Qualität der Abscheidungen und die supraleitenden Eigenschaften der Dünnschichten gelegt, sondern auch auf die Benutzerfreundlichkeit der Anlagen, deren einfache und schnelle Einarbeitung für neue Nutzer sowie auf ihre flexible, aber dennoch robuste Fähigkeit zur Prozesskontrolle in einem F&E-Umfeld. Ebenso wird großer Wert auf die Nähe und Reaktionsfähigkeit des Lieferanten hinsichtlich des gesamten technischen Supports und der Prozessunterstützung gelegt. Im Einklang mit den Anforderungen der EPFL sowie den wissenschaftlichen Zielen des CMi und der UNIGE wird besonderes Augenmerk auf die folgenden Punkte gelegt: • Qualität, Reproduzierbarkeit und Gleichmäßigkeit der supraleitenden Dünnschichten. • Integration mit unseren Infrastrukturen.

Kennung des Verfahrens: 2ff1d4c4-0724-44b8-bcaa-4e1d247e13f6

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Lausanne

Postleitzahl: 1015

Land, Gliederung (NUTS): Vaud (CH011)

Land: Schweiz

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Sonstige Anforderungen - Die Auftraggeberin vergibt diesen Auftrag nur an Anbieter, welche die in den Ausschreibungsunterlagen und der Besetzgebung festgelegten Teilnahmebedingungen einhalten. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit, des Umweltrechts und das wettbewerbskonforme und korruptionsfreie Verhalten. - Interessierte Firmen müssen sich auf www.simap.ch registrieren um auf das Pflichtenheft und die Beilagen zugreifen zu können. - Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite. - Um die Aktualität der Information und die Gleichbehandlung der Anbieter zu gewährleisten, werden zur Beurteilung nur jene Offerten berücksichtigt, welche nach der Veröffentlichung der Ausschreibung auf dem Server www.simap.ch eingereicht wurden.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

2.1.6. Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Eine Sputter-Abscheidungsanlage, speziell für die Herstellung von qualitativ hochwertigen supraleitenden Dünnschichten

Beschreibung: Die EPFL plant in enger Zusammenarbeit mit der Universität Genf (UNIGE) die Anschaffung einer hochmodernen Sputter-Abscheidungsanlage, die speziell für die Herstellung von qualitativ hochwertigen supraleitenden Dünnschichten konzipiert ist. Die Anlage wird im EPFL Center of MicroNanotechnology (EPFL CMi) installiert und betrieben. Das CMi ist eine zentralisierte Einrichtung für die Mikro- und Nanofabrikation, die allen Fakultäten der EPFL dient und sowohl externen Universitäten als auch lokalen Industriepartnern offensteht (über 600 aktive Nutzer pro Jahr). Die neue Anlage wird für Spitzenforschung im Bereich der Einzelphotonendetektoren eingesetzt, mit dem Ziel, die Lücke zwischen der Laborfertigung und der industriellen Produktion zu schließen, indem sie die Abscheidung auf Wafern mit einem Durchmesser von 200 mm ermöglicht. Besonderes Augenmerk wird nicht nur auf die Qualität der Abscheidungen und die supraleitenden Eigenschaften der Dünnschichten gelegt, sondern auch auf die Benutzerfreundlichkeit der Anlagen, deren einfache und schnelle Einarbeitung für neue Nutzer sowie auf ihre flexible, aber dennoch robuste Fähigkeit zur Prozesskontrolle in einem F&E-Umfeld. Ebenso wird großer Wert auf die Nähe und Reaktionsfähigkeit des Lieferanten hinsichtlich des gesamten technischen Supports und der Prozessunterstützung gelegt. Im Einklang mit den Anforderungen der EPFL sowie den wissenschaftlichen Zielen des CMi und der UNIGE wird besonderes Augenmerk auf die folgenden Punkte gelegt: • Qualität, Reproduzierbarkeit und Gleichmäßigkeit der supraleitenden Dünnschichten. • Integration mit unseren Infrastrukturen.

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 38000000 Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser)

Optionen:

Beschreibung der Optionen: Siehe Pflichtenheft.

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Lausanne

Postleitzahl: 1015

Land, Gliederung (NUTS): Vaud (CH011)

Land: Schweiz

5.1.3. Geschätzte Dauer

Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.4. Verlängerung

Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Noch nicht bekannt

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Zuschlagskriterien

Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. Auftragsunterlagen

Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt

Informationen über zugangsbeschränkte Dokumente einsehbar unter: [https://www.simap.ch/fr/redirect?](https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0kljpudWxsLCJwcm9qZWNoSWQ)

[context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0kljpudWxsLCJwcm9qZWNoSWQ](https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0kljpudWxsLCJwcm9qZWNoSWQ)

Ad-hoc-Kommunikationskanal:

Name: Simap.ch

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Zulässig

Adresse für die Einreichung: [https://www.simap.ch/fr/redirect?](https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0kljpudWxsLCJwcm9qZWNoSWQ)

[context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0kljpudWxsLCJwcm9qZWNoSWQ](https://www.simap.ch/fr/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0kljpudWxsLCJwcm9qZWNoSWQ)

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 04/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 160 Tage

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Noch nicht bekannt

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Bundesverwaltungsgericht

Informationen über die Überprüfungsfristen: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: EPFL-Scientific Equipment

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: EPFL-Scientific Equipment

Registrierungsnummer: b0e84e68-ed68-4cbd-86d3-4f54aea147cc

Postanschrift: EPFL AVP-CP ECO BI A2 447 (Bâtiment BI) Station 7

Stadt: Lausanne

Postleitzahl: 1015

Land, Gliederung (NUTS): Vaud (CH011)

Land: Schweiz

E-Mail: jerome.butty@epfl.ch

Telefon: +41216931111

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht

Registrierungsnummer: BVGER
Postanschrift: Postfach
Stadt: St. Gallen
Postleitzahl: 9023
Land, Gliederung (NUTS): St. Gallen (CH055)
Land: Schweiz
E-Mail: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Internetadresse: <https://www.bvger.ch>
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Simap.ch
Registrierungsnummer: CH001
Postanschrift: Holzikofenweg 36
Stadt: Bern
Postleitzahl: 3003
Land, Gliederung (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Land: Schweiz
E-Mail: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Internetadresse: <https://www.simap.ch>
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: bafbf74a-e5a4-4b63-b048-c044de215176 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 25/09/2026 02:25:58 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch, Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 665827-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 187/2026
Datum der Veröffentlichung: 28/09/2026